

## Л и т е р а т у р а

- [1] Касаткин В. А., Макаренко В. Г., Сидоров В. Г., Целищева Н. С., Шлихтов С. Н. Получение GaP без электрических активных кислорода. — Электрон. техн., сер. 6, Материалы, 1983, в. 5 (178), с. 29—31.
- [2] Ennen H., Schneider J. — Proc. 13 Int. Conf. Def. Semicond. California, 1984, p. 115—127.
- [3] Касаткин В. А., Кесаманлы Ф. П., Мастеров В. Ф., Романов В. В., Саморуков Б. Е. Влияние примесей лантаноидов на свойства GaP. — Изв. АН СССР, Неогр. матер., 1980, т. 16, в. 11, с. 1901—1905.
- [4] Podor B., Pfeifer J., Csontos L., Nador N., Deak F. — Phys. St. Sol. (a), 1983, v. 76, N 2, p. 695—704.
- [5] Siegel W., Kühnel G. — Phys. St. Sol. (a), 1984, v. 84, N 1, p. 251—262.
- [6] Hara T., Akasaki I. — J. Appl. Phys., 1968, v. 39, N 2, p. 285—290.
- [7] Барабанский П. И., Беляев А. Е., Городничий О. П., Сытлина Н. Г., Томчук П. М. О механизмах рассеяния в фосфиде галлия. — ФТП, 1979, т. 13, в. 3, с. 488—493.
- [8] Беляев А. Е., Городничий О. П., Пидлусный Е. В. Величина отношения констант деформационного потенциала в кристаллах *n*-GaP. — ДАН УССР, сер. А, 1981, № 7, с. 54—57.

Институт полупроводников  
АН УССР  
Киев

Получено 27.04.1987  
Принято к печати 2.06.1987

*ФТП, том 22, вып. 1, 1988*

### ПРИРОДА ПРИМЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ (ЖЕЛЕЗОМ И ЕВРОПИЕМ) В АМОРФНОМ ГИДРИРОВАННОМ КРЕМНИИ

Регель А. Р., Серегин П. П., Мездрогина М. М., Наирединов Ф. С.,  
Аблова М. С., Абдуманапов У. Ж.

Проблема легирования аморфного гидрированного кремния *a*-Si(H) давно привлекает внимание исследователей [1]. Основным методом, приводящим к эффективному изменению электрических свойств *a*-Si(H), является легирование из газовой фазы [2]. В настоящей работе приводятся результаты по легированию *a*-Si(H) переходными металлами (железом, европием) методом распыления.

Образцы были получены высокочастотным совместным распылением моно-кристаллической кремниевой мишени и мишени из металлического железа (или европия) в газовой смеси гелия, аргона и силана [3]. Температура подложки была 250, 300 и 380 °C. Концентрация металла составляла 0.1 ат%, концентрация водорода — 15 ат%. Темновая проводимость  $\sigma_t$  и фотопроводимость  $\sigma_f$  определялись в планарной геометрии. Фотопроводимость измерялась при 295 K при освещении светом с интенсивностью  $4 \cdot 10^{17}$  фот/см<sup>2</sup>·с и длиной волны 0.65 мкм. Положение края оптического поглощения определялось при 295 K. Мессбауэровские спектры примесных атомов <sup>57</sup>Fe и <sup>151</sup>Eu измерялись при 295 и 80 K с источниками <sup>57</sup>Co в палладии и <sup>151</sup>Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Параметры электропроводности *a*-Si(H)

Состав образцов	$T_s$ , °C	$E_g$ , эВ	$\sigma_{t, \text{н}}$ , $\Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$	$\sigma_{f, 295}, \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$
<i>a</i> -Si(H)	380	0.58	280	$3.4 \cdot 10^{-8}$
<i>a</i> -Si(H)+Fe	380	0.80	320	$1.9 \cdot 10^{-11}$
<i>a</i> -Si(H)+Eu	380	0.20	0.56	$5.0 \cdot 10^{-3}$
<i>a</i> -Si(H)	300	0.71	1300	$6.3 \cdot 10^{-10}$
<i>a</i> -Si(H)+Fe	300	0.69	89	$9.5 \cdot 10^{-11}$
<i>a</i> -Si(H)+Eu	300	0.56	320	$5.0 \cdot 10^{-7}$
<i>a</i> -Si(H)	250	0.70	180	$1.5 \cdot 10^{-10}$
<i>a</i> -Si(H)+Fe	250	0.69	200	$1.9 \cdot 10^{-10}$
<i>a</i> -Si(H)+Eu	250	0.68	1300	$1.0 \cdot 10^{-9}$

Все нелегированные образцы  $a\text{-Si(H)}$  обладали электронной проводимостью (знак термоэдс был отрицательным при комнатной температуре, абсолютное значение термоэдс  $\sim 200$  мкВ/К), оптическая ширина запрещенной зоны была  $1.70 \pm 0.02$  эВ, и, как видно из рис. 1, температурная зависимость электропроводности является линейной функцией в координатах  $\lg \sigma - 1/T$  в интервале температур 100—500 К. Следовательно, проводимость для нелегированных образцов в выбранном температурном интервале осуществляется электронами на делокализованных состояниях, лежащих выше порога подвижности  $E_c$ , а энергия активации проводимости  $E_a$  определяется как  $E_a = E_c - F$ , где  $F$  — уровень Ферми. Параметры электропроводности и фотопроводимости существенным образом зависят от температуры подложки  $T_s$  (см. таблицу), причем изменение

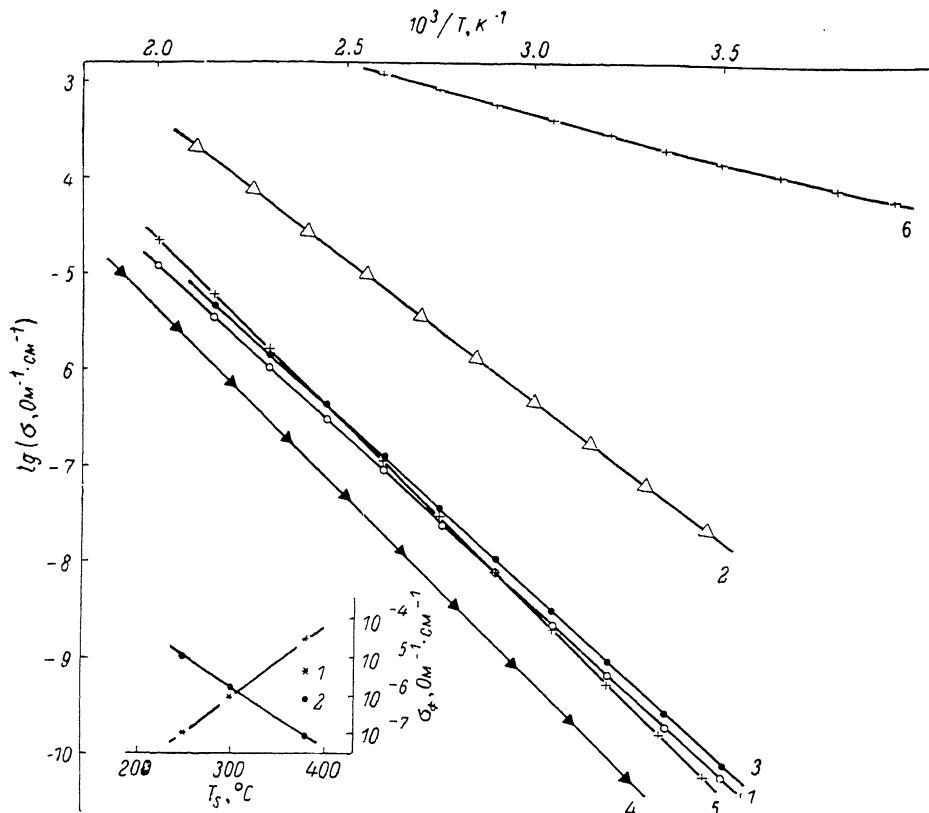


Рис. 1. Температурные зависимости электропроводности  $a\text{-Si(H)}$  (1, 2),  $a\text{-Si(H)}+\text{Fe}$  (3, 4) и  $a\text{-Si(H)}+\text{Eu}$  (5, 6).

Температура подложки, °С: 1, 3, 5 — 250; 2, 4, 6 — 380. На вставке — зависимость фотопроводимости от  $T_s$  для  $a\text{-Si(H)}$  (1) и  $a\text{-Si(H)}+\text{Fe}$  (2).

величин  $\sigma_t$ ,  $\sigma_\phi$  и  $E_a$  при увеличении  $T_s$  имеет тот же характер, что и для пленок  $a\text{-Si(H)}$ , полученных разложением силана (см., например, [2]). Очевидно, как и в случае  $a\text{-Si(H)}$ , полученного разложением силана, для исследованных нами пленок увеличение  $T_s$  ведет к уменьшению концентрации собственных дефектов и сдвигу уровня Ферми к  $E_c$  (для образца, полученного при  $T_s = 380$  °С,  $E_c = 0.58$  эВ).

При введении железа в  $a\text{-Si(H)}$  характер зависимостей меняется: величины  $\sigma_t$  и  $\sigma_\phi$  при увеличении  $T_s$  уменьшаются, а  $E_a$  увеличивается (см. рис. 1 и таблицу), т. е. легирование  $a\text{-Si(H)}$  железом сдвигает уровень Ферми к середине запрещенной зоны. Особенно сильно эффект легирования проявляется для пленок, полученных при  $T_s = 380$  °С ( $E_a = 0.80$  эВ). Коэффициент термоэдс и оптическая ширина запрещенной зоны не зависят от легирования.

Структура мессбауэровских спектров  $^{57}\text{Fe}$  зависит от температуры подложки. Для образцов, полученных при  $T \leq 300$  °С, они представляют собой

квадрупольные дублеты (при 295 К изомерный сдвиг  $\delta=0.20\pm0.02$  мм/с, квадрупольное расщепление  $\Delta=0.34\pm0.03$  мм/с). Согласно [3], этот спектр отвечает ассоциатам «железо—вакансия». Для образцов, полученных при  $T_s=380$  °C, наряду с указанным дублетом появляется дополнительный синглет, отвечающий изолированным атомам железа в состоянии  $Fe^{3+}$  ( $\delta=0.35$  мм/с относительно  $\alpha$ -Fe; рис. 2, a). Очевидно, эти центры железа ответственны за изменение электрической проводимости.

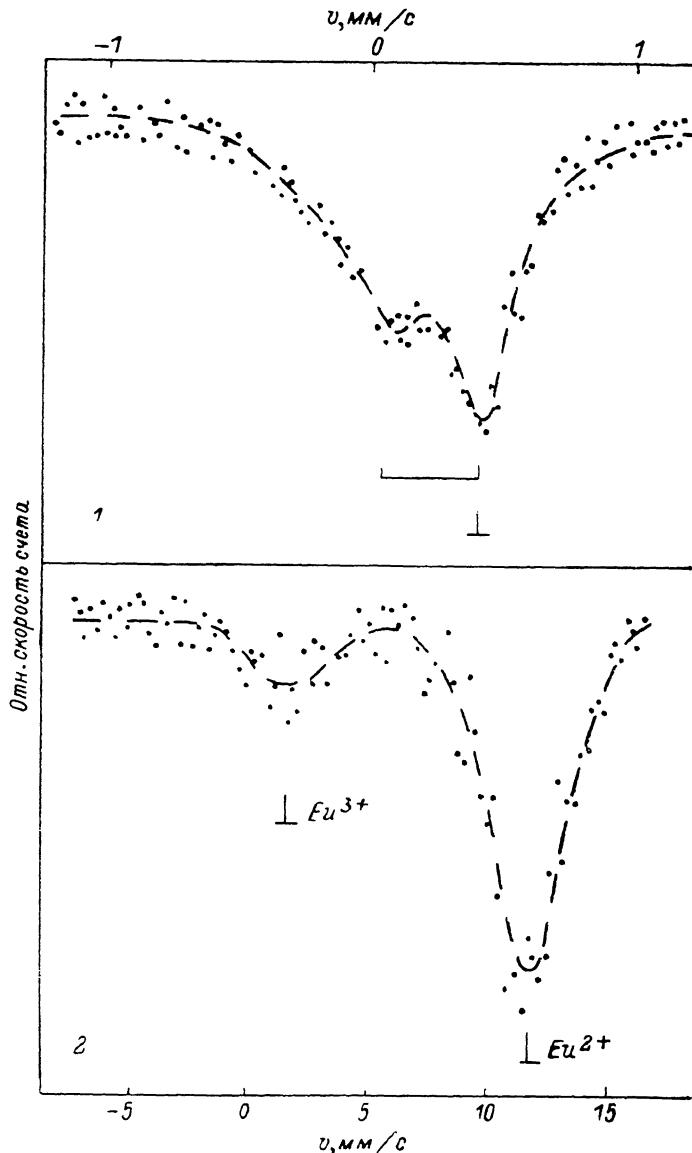


Рис. 2. Мессбауэровские спектры примесных атомов  $^{57}Fe$  (1) и  $^{151}Eu$  (2) в  $a$ -Si (H), полученному при  $T_s=380$  °C.

Для спектра  $^{57}Fe$  показано разложение на квадрупольный дублет и одиночную линию.

тропроводности легированного  $a$ -Si(H). При  $T_s \leq 300$  °C концентрация вакансий превышает концентрацию железа и практически все примесные атомы оказываются связанными в электрически неактивные комплексы «железо—вакансия». При  $T_s=380$  °C концентрация вакансий понижается и значительная часть атомов железа [по интенсивности мессбауэровского спектра  $(1\div2)\cdot10^{19}$  см $^{-3}$ ] находится в электрически активном состоянии.

Воздействие примеси железа на электрические свойства  $a$ -Si(H) заключается в том, что изолированные атомы железа образуют в щели подвижности полосу акцепторных уровней. Синглет  $Fe^{3+}$  в мессбауэровском спектре принадлежит

нейтральному состоянию акцепторного центра железа. Отсутствие в спектре линии  $\text{Fe}^{2+}$ , которая должна соответствовать ионизованному состоянию центра, свидетельствует о малой степени заполнения акцепторной полосы, т. е. о том, что уровень Ферми находится в ее нижней части. Это соответствует малой по сравнению с концентрацией акцепторных центров железа плотности состояний в зазоре между положениями  $F$  в легированном и нелегированном образцах. Уровень Ферми в легированных железом образцах, полученных при  $T_s = -380^\circ\text{C}$ , по-видимому, привязан к акцепторной полосе железа, а значение  $E_c = -0.80$  эВ указывает на положение этой полосы относительно  $E_F$ . Однако эта величина может оказаться верхней оценкой для  $E_c - E_{\text{Fe}}$  ( $E_{\text{Fe}}$  — положение полосы железа), так как центры железа в основном нейтральны и  $F$  может быть зафиксирован ниже полосы железа. Центры железа могут, видимо, выступать и как центры рекомбинации, что уменьшает фотопроводимость легированного материала (рис. 1).

В отличие от железа примесные атомы европия увеличивают электропроводность  $a\text{-Si(H)}$ , но легирующий эффект, как и для железа, возрастает при увеличении  $T_s$  (см. рис. 1 и таблицу). Коэффициент термоэдс и оптическая ширина запрещенной зоны не зависят от легирования. Все это означает, что введение европия в  $a\text{-Si(H)}$  сдвигает уровень Ферми к  $E_c$  (для образца, полученного при  $T_s = -380^\circ\text{C}$ ,  $E_c = 0.25$  эВ). Действие примеси европия можно объяснить образованием в щели подвижности  $a\text{-Si(H)}$  полосы донорных уровней, электроны с которых заселяют нижележащие пустые состояния и поднимают уровень Ферми. Эффективность легирования в такой модели должна возрастать при уменьшении концентрации собственных дефектов, что и проявляется в зависимости  $F$  от температуры подложки в легированных европием образцах (см. таблицу).

Мессбауэровские спектры  $^{151}\text{Eu}$  в  $a\text{-Si(H)}$  (рис. 2, б) состоят из двух линий, отвечающих  $\text{Eu}^{2+}$  ( $\delta = -11.7$  мм/с) и  $\text{Eu}^{3+}$  ( $\delta = -1.7$  мм/с, оба сдвига относительно  $\text{Eu}_2\text{O}_3$ ). Эти линии относятся к нейтральному и ионизованному состояниям донорного центра европия соответственно. В образовании химических связей участвуют два 6s-электрона, а один из 4f-электронов европия играет роль донорного электрона.

Таким образом, железо и европий образуют в  $a\text{-Si(H)}$  электрически активные центры, нейтральное состояние которых соответствует ионам с полузаполненной оболочкой  $3d^5$  для железа и  $4f^7$  для европия. Различный характер (акцепторный или донорный) электрической активности центров железа и европия, по-видимому, следует связывать с различием свойств полузаполненных оболочек  $3d$  и  $4f$  этих элементов.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Аморфные полупроводники / Под ред. М. Бродски. М., 1982. 419 с.
- [2] Hydrogen amorphous silicon Electronic and transport properties / Ed. by J. Pankove. N. Y.—London, 1984. 437 p.
- [3] Насрединов Ф. С., Мездрагина М. М., Подхалюзин В. П., Серегин П. П. Мессбауэровское исследование примесных атомов железа в аморфном кремнии. — ФТТ, 1986, т. 28, в. 8, с. 2543—2546.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Получено 18.05.1987  
Принято к печати 2.06.1987

ФТП, том 22, вып. 1, 1988

#### О МЕХАНИЗМЕ ДИФФУЗИИ БОРА В КАРБИДЕ КРЕМНИЯ

Константинов А. О.

Диффузия бора является одним из основных методов создания  $p-n$ -переходов на карбиде кремния и исследовалась в большом количестве экспериментальных работ [1—6]. В этих работах был установлен ряд аномальных особенностей